ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ВИСМУТА

А. С. Федотов, А. В. Мазаник, С. К. Позняк, В. Г. Шепелевич, А. К. Федотов

Белорусский государственный университет, fedotov@bsu.by

введение

В последние годы широко ведутся исследования по созданию термоэлектрических материалов для изготовления относительно недорогих микроминиатюрных термоэлектрогенераторов и охладителей Пельтье в пленочном исполнении. Такие устройства могут быть использованы в системах контроля и стабилизации температуры интегральных схем и других приборов при температурах существенно ниже комнатной. В терминах цена/качество, для этих целей могут быть полезны пленки висмут содержащих сплавов. Однако, в этом случае необходимо понять роль зеренной структуры (размеров зерен и плотности межзеренных границ) в формировании таких рабочих параметров поликристаллических пленок как удельное сопротивлении о, коэффициента Зеебека S и постоянной Холла R_H в широкой области температур T и магнитных полей В. В данной статье исследовано влияние размеров зерен на электрические свойства пленок поликристаллического висмута, полученных разными способами.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Исследования были проведены на трех типах пленок: изготовленных методом центробежного затвердевания (ЦЗ), электрохимического осаждения (ЭО), часть из которых была подвергнута отжигу (ОЭО образцы). Методики получения пленок детально описаны в работе [1].

Исследование морфологии зеренной структуры образцов (на поверхности и в сечении пленок) проводилось на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) LEO 1455VP с приставкой для изучения дифракции отраженных электронов (ДОЭ), а также методом рентгеновского дифракционного анализа (РДА).

Для измерения температурных и магнитополевых зависимостей $\rho(T,B)$, S(T,B) и $R_H(T,B)$ была использована измерительная система на базе рефрижератора замкнутого цикла Cryogenic Ltd, позволявшая проводить измерения в области температур 2 – 300 К в полях до 8 Тл. Относительные ошибки для измерения ρ , магнитосопротивления (MC) и R_H не превышали 5%; 0,2% и 1%, соответственно. Точность измерения S составляла 2% выше 200 К и 10% в области гелиевых температур.

СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СЭМ изображения поперечных сечений пленок, приведенные на вставках к рис.1, показывают, что в ЭО образцах размеры зерен лежат в диапазоне $L_G = 0,5 \div 1,5$ мкм, в ЦЗ образцах зёрна на порядок крупнее (5 ÷ 15 мкм), а в ОЭО образцах ~ 10-60 мкм. ДОЭ и РДА указывают на наличие текстур типа (001) и (121) для ЦЗ пленок и (012) для ОЭО образцов. В пленках ЭО текстура не обнаружена.



Puc. 1. Температурные зависимости удельного сопротивления ρ(T) (*a*), коэффициента Зеебека S(T) (*б*) и постоянной Холла в магнитном поле В = 0,25 Тл (*в*) пленок Ві, полученных разными методами. На вставках показаны СЭМ изображения пленок ЦЗ (*a*), ЭО (*б*) и ОЭО (*в*)

Как видно из рис. 1а, в исходных ЦЗ и ЭО образцах наблюдается радикально различающиеся зависимсоти р(Т) в изученной области температур с отрицательным знаком температурного коэффициента сопротивления ТКС = (dp/dT) – отрицательный у ЭО и положительный у ЦЗ образцов. После отжига у ЭО пленок ТКС >0. Кривые S(T) для всех типов пленок отрицательны и их модуль имеет максимумы пр T ~ 200 R (рис. 1б). При комнатной температуре коэффициент Зеебека несколько меньше для ЦЗ образцов по сравнению с обоими типами пленок, полученных электрохимическим осаждением. Коэффициент Холла у всех пленок тоже отрицателен и снижается с ростом температуры (рис. 3в), что согласуется с результатами других работ [2,3].

В целях более детального изучения транспортных свойств в пленках висмута, были исследованы температурные и полевые зависимости относительного MC = $\Delta\rho/\rho_o = [\rho(B) - \rho(0)]/\rho(0)$. Эти измерения показали, что при 4 К значения MC в магнитном поле B = 8 T составили около 4500 для ОЭО пленок, в то время как для C3 пленок оно ~ 1600 и для неотожженных ЭО пленок ~ 12.

Для оценки температурных зависимостей концентрации носителей и подвижности, используя некоторые теоретические модели, мы изучили дополнительно в деталях ход MC(B,T) в диапазоне низких значений индукции магнитного поля. Как

следует из рис. 2, для всех температур низкополевые кривые MC(B) в двойном логарифмическом масштабе в крупнозернистых ОЭО и ЦЗ пленках лежат очень близко друг к другу, а ЭО пленки показывают значительно более низкие значения MC. В контексте упомянутой выше различной зернистости пленок, такое поведение, повидимому, свидетельствует о сильном влиянии плотности границ зерен на эффект MC.

Параллельность кривых на рис. 2 с тангенсом угла наклона близким к 2 для всех температур означает параболичность зависимостей MC(В). Такое поведение (вместе с увеличением MC при снижении температуры) можно легко объяснить Лоренцевым механизмом магниторезистивного эффекта. Действительно, сила Лоренца приводит к значительному искривлению траекторий носителей заряда если электроны и дырки слабо рассеиваются на колебаниях решетки и дефектах, то есть длина свободного

пробега l достаточно велика [4]. При сравнении относительной роли рассеяния носителей заряда на фононах и на границах зерен, мы должны принять во внимание следующее. При высоких температурах $l \ll L_G$ из-за высокой плотности фононов последние выступают в качестве основных ограничителей длины свободного пробега, приводя к снижению МС. При низких температурах, когда l становится близкой к L_G , роль рассеяния носителей на границах зерен возрастает.

Результаты оценок температурных зависимостей концентраций (n = p) и подвижностей (µ_n, µ_p) электронов и дырок исходя из модельных представлений, изложенных в работах [2, 5-9], представлены на рис. 3-4. Во всех расчетах использованы модельные уравнения и экспериментальные результаты для зависимостей $\rho(T)$ и MC(T), а также либо R_H(T,B) (модель A) либо S(T) (модель B). Как видно из рис. За, расчетные точки на кривых кривые n(T) = p(T) весьма слабо различаются для всех образцов, показывая рост концентраций с температурой. Полученные нами оценки весьма близки к результатам известным из литературы [2]. Отметим также, что расчетные точки для каждого из образцов совпадают для обоих моделей с точностью 0,1 %, что существенно меньше экспериментальных ошибок для измерений соответствующих величин.



Рис. 2. Полевые зависимости МС при T = 300 K (*a*) / 100 K (*б*) и 25 K (*в*)

Подвижности носителей у мелкозернистого ЭО образца слабо зависят температуры

при T < 200 К (рис. 3e), хотя для ЦЗ и ОЭО пленок они существенно сильнее (рис. 3e и 3e). При этом результаты расчетов на основе моделей А и Б они существенно различаются при всех исследованных температурах.

Сопоставим наблюдаемое поведение кривых $\mu_n(T)$ и $\mu_p(T)$, учитывая три основных механизма рассеяния: на границах зерен, других структурных искажений решетки (точечные дефекты, дислокации и т.д.) и на атомные колебаниях. Как известно [10], эффективность рассеяния носителей на структурных несовершенствах кристаллической решетки должна лишь слабо меняться от температуры по сравнению с рассеянием на фононах. Напомним, что линейная плотность границ зерен значительно выше в ОЭ пленках, что дает возможность при низких температурах рассматривать рассеяние на границах зерен как доминирующий механизм в этих образцах. При этом следует отметить, что для этих пленок при учете рассеяния на акустических фононах модельные аппроксимации дают серьезное расхождение между $\mu_n(T)$ и $\mu_p(T)$ на рис. Зв при использовании систем уравнений A (с использованием коэффи-



циента Холла) и Б (для коэффициента Зеебека): оно достигает 75 % для дырок и 45 % для электронов. С другой стороны, это расхождение для образцов ЦЗ и ОЭО было лишь ~ 20 %.



Рис. 3. Температурные зависимости концентрации носителей заряда всех типов образцов (*a*) и для подвижностей электронов и дырок для пленок ЦЗ (б), ЭХ (в) и ЭХО (г) исследуемых образцов поликристаллических пленок висмута, рассчитанных с помощью моделей А и В

Возвращаясь к рис. 1а, попытаемся объяснить разницу в температурных зависимостях удельного сопротивления в крупно- и мелкозернистых пленках. Как следует известных моделей, сопротивление обратно пропорционально произведению концентраций и подвижностей носителей заряда. Как видно из рис. За, концентрации электронов (дырок) увеличиваются примерно в 8 раз в изучаемой температурой области 25-300 К для всех образцов. В то же время, в мелкозернистых ОЭ образцах подвижности носителей уменьшаются при понижении температуры всего в 2-3 раза, в то время как в крупнозернистых ЦЗ и ОЭО пленках μ_n и μ_p снижаются более чем на порядок. Поскольку в ОЭ образцах подвижность медленнее уменьшается с ростом температуры (поскольку эффективность рассеяния на границах зерен слабо зависит от температуры), температурная зависимость сопротивления будет определяться в основном температурной зависимостью концентрации носителей. В то же время, для крупнозернистых ЦЗ и ОЭО пленок подвижности носителей быстро уменьшаются с увеличением температуры (вследствие сильной роли зависимости от температуры рассеяния на фононах), тогда как концентрация носителей увеличивается. Поэтому температурная зависимость сопротивления для крупнозернистых образцов должны быть в основном определяться температурными зависимостями подвижностей электронов и дырок.

ЛИТЕРАТУРА

- Boettinger, W.J. Rapidly solidified alloys: processes, structures, properties, applications / Boettinger W.J., Perepezko J.H., Liebermann H.H. // New York: Marcel Dekker Inc., 1993, 251.
- Gallo C.F. Transport Properties of Bismuth Single Crystals / Boettinger W.J., Perepezko J.H., Liebermann H.H. // J. Appl. Phys. 1963. 11. 268.
- Kochowski S. Concentration and mobility of charge carriers in thin polycrystalline films of bismuth. / Kochowski S, Opilski A. // Thin Solid Films. 1978. 48. 345.
- 4. *Jeun M.H.* Magnetoresistance in Semimetallic Bismuth Thin Films / Jeun MH, Lee KI, Lee WY. // J Korean Phys. Soc. 2005. 46. S80.
- 5. Seeger K. Semiconductor Physics: An Introduction. // 6th ed. Berlin: Springer. 1997. 403.
- Ehrstein J.R. Nondestructive Evaluation of Semiconductor Materials and Devices. // New York: Springer US. 1979. 521.
- 7. Lax B. Infrared magnetoreflexion in bismuth. / Lax B, Mavroides J.G., Zeiger H.J., Keyes R.J. // Phys. Rev. Lett. 1960. 5. 241.
- Nakamura D. Thermoelectric properties for single crystal bismuth nanowires using a mean free path limitation model. / Nakamura D, Murata M, Yamamoto H, Hasegawa Y et al. // J Appl Phys. 2011. 110. 053702.
- 9. Heremans J. Influence of non-parabolicity on intravalley electron-phonon scattering: the case of bismuth. / Heremans J, Hansen OP. // J. Phys. C: Solid State Phys. 1979. 12. 3483.
- 10. Kittel C. Introduction to Solid State Physics. // 8th ed. New Caledonia: John Wiley & Sons. 2004. 564.

ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК И МАССИВОВ НАНОКРИСТАЛЛОВ ZnO/Er ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Е. Б. Чубенко, В. П. Бондаренко

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, eugene.chubenko@gmail.com

введение

Оксид цинка (ZnO) – широкозонный полупроводник ($\Delta Eg = 3,37$ при T = 300 K), обладающий уникальным сочетанием физических свойств, обеспечивающим широкий спектр его применений [1]. Высокий коэффициент пропускания в видимом и ближнем ИК-диапазоне открывает возможность использования ZnO в тонкопленочных солнечных элементах [2]. Введение различных примесей приводит к изменению оптических и электрофизических свойств ZnO, позволяя применять его в качестве материала прозрачных проводящих электродов или функциональных слоев [1, 2]. Пленки ZnO могут выступать в качестве матрицы, содержащей люминесцентные частицы веществ, участвующих в процессе поглощения квантов света. Введение ионизированных атомов эрбия (Er) позволяет увеличить эффективность работы тонкопленочных солнечных элементов, так как ионы Er способны поглощать излучение в инфракрасном диапазоне в области длин волн 1,54 мкм, переизлучая поглощенную энергию в виде более высокоэнергетических фотонов, и расширяя, таким образом, спектр поглощаемого солнечным элементом излучения [3].

ZnO может быть получен методом электрохимического осаждения [4], обладающего такими существенными для изготовления тонкопленочных элементов преимуществами, как возможность одновременной обработки больших площадей и низкой